Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04086283

PUBLICATION DATE

18-03-92

APPLICATION DATE

30-07-90

APPLICATION NUMBER

02204852

APPLICANT: SHARP CORP;

INVENTOR: OTANI NOBORU:

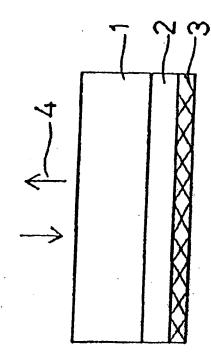
INT.CL.

B41M 5/26 G11B 7/24

TITLE

OPTICAL RECORDING MATERIAL AND

OPTICAL DISK



ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to reduce a noise level during regeneration and allow the reflection factor of recorded bits to change significantly by mixing bismuth oxide, silicon dioxide and chromous phosphoric acid at a specific molecular ratio.

CONSTITUTION: Bismuth oxide (Bi₂O₃), silicon dioxide (SiO₂) and chromous phosphoric acid (CrPO₄) are mixed at a molecular ratio of Bi₂O₃/(CrPO₄+ SiO₂)=2 to 10. Then CrPO₄/SiO₂ is blended at a molecular ratio of 1:1 to form an optical recording material. In addition, a film 2 is formed on a transparent substrate 1 using the optical recording material, then a reflective film 3 is formed on the film 2 and the reflective film is constituted using Cu, Ag or Au to form an optical disk. An area which becomes transparent thermally by projection of a laser beam does not have a structural change of a crystal which can be detected optically and also have a definite threshold value for a temperature at which the area becomes transparent. Therefore, an optical disk thus obtained reduces a recording noise level and allows non-destructive reading of data which is indispensable for optical recording.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO&Japio

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

平4-86283 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

®Int. Cl. 5

識別配号

庁内整理番号

@公開 平成 4年(1992) 3月18日

B 41 M 5/26 G 11 B 7/24

Α 7215-5D

8305-2H B 41 M 5/26 X

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

60発明の名称 光記録材料及び光デイスク

> 願 平2-204852 20特

願 平2(1990)7月30日 220出

@発 明 者 大 谷 昇 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

シャープ株式会社 勿出 願 人

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

弁理士 野河 信太郎 四代 理 人

明細醬

1. 発明の名称

光記録材料及び光ディスク

2. 特許請求の顧用

1. 酸化ビスマス(Bi,O,)、二酸化シリコ ン (SiO₂)及び燐酸第二クロム (CrPO₂) MB 1 20 1/ (CrPO + SiO) = 2 ~ 10 のモル比で混合されてなる光記録材料。

2. CrPO./SiO.が、1/1のモル比で 混合されてなる請求項1の光記録材料。

8. 透明基板上に請求項1の光記録材料の薄膜 が形成され、この上に反射膜が形成されてなる光 ディスク。

4. 反射膜がCu、Ag又はAuから構成され る請求項3の光ディスク。

3. 発明の詳細な説明

(イ)産業上の利用分野

この発明は、光記録材料及び光ディスクに関す る。さらに詳しくは、レーザービームによりヒー トモード記録を行うための光記録材料及び光ディ

スクに関し、特に一度だけ記録可能な追記型光記 燥に用いられる。

(ロ)従来の技術

追記型光ディスクに用いられる光記録材料は、 多くの材料が提案されているが、その記録メカニ ズムからピット(孔) 形成型の破壊記録型材料と 相変化型の非破壊記録型材料に分類される。

ピット形成型の光ディスクは、基板に成膜した Te系化合物、シアニン系有機色素等の低融点材 料の薄膜にレーザービームをスポット照射して、 その局部を融解、蒸発させ、微少な孔(ピット) を形成することによって情報を記録し、記録邸と 未記録部の反射率差を検出して情報の再生を行う ものである。また、このピット形成型の光ディス クは、その記録メカニズムから反射膜を形成した 構造とすることができないため、大きな反射率変 化を得ることは難しい。特に、有機色素系光紀録 材料は、成膜をスピンコート法で行えるなど安価 に製造できるという利点がある一方、材料自体の 反射率が低いため、コントラストが低いという性

能上の欠点を有している。また、ピット形成型の 光ディスクは、ディスク両面に情報を記録することができる両面仕様ディスクとした場合、エアー サンドイッチ構造としなければならず、信頼性、 生産性の点で好ましくない。

- 3 -

合が生じる。また、二酸化シリコンと燐酸第二クロムとの混合モル比SiO,/CrPO.は、通常0.8~1.2が好ましい。

上記組成の光記録材料は、薄膜形成後の光吸収 係数の大きい状態でレーザービームを照射し、加 熱により局所的に透明化して情報を記録し、情報 の再生は反射率変化を光学的に検出して行うもの である。その際、加熱により透明化した領域は結 晶化等の光学的に検出し得る構造変化を伴わず、 また、透明化する温度に明確なしきい値が存在す るため、記録ノイズの低減、及び光記録に不可欠 な非破壊読み出しが可能である。

この発明によれば、透明基板上に上記光記録材料の薄膜が形成され、この上に反射膜が形成され てなる光ディスクが提供される。

上記透明基板は、レーザービームを通過しうる ものが適しており、例えばガラス、ポリカーボネ ート、ポリメチルメタクリレート樹脂等を用いて 形成することができる。

上記記録材料の薄膜は、透明基版の上に、必要

(ハ)発明が解決しようとする課題

この発明は、上記欠点を解決するためになされたものであって、密着貼合わせ型両面仕様ディスク構造を採用できるとともに、再生時のノイズが低く、かつ、記録ビットの反射率変化を大きくとることができ、従って大きなCNRを得ることのできる追記型の光記録材料及び光ディスクを提供するものである。

(二)課題を解決するための手段

この発明によれば、酸化ビスマス(Bi_{*}O₃)、 二酸化シリコン(SiO₃)及び燐酸第二クロム (CrPO₄)がBi_{*}O₃/(CrPO₄+SiO₃) = 2~10のモル比で混合されてなる光記録材料 が提供される。

上記混合モル比 Bi.O./(CrPO.+SiO.)は2~10が適しており、大きくなる程低温でしきい値を持つ傾向にあり、特に4~8が好ましい。この混合モル比が、2未満では十分な反射率変化が得られないという不都合が生じ、10超では記録しきい値が300で以上になるという不都

-4.

に応じて誘躍体験等を介在させて、例えば電子ビーム蒸着法等の二元蒸着法あるいはスパッタ法等によってBl.O.、SiO.及びCrPO.を所定の割合で混合し、所定機厚に成職して形成することができる。この機厚は、通常100~300nmが好ま

この発明によれば、この上に必要に応じて誘電体膜等を介在させて反射膜が形成される。上記反射膜は、光記録材料薄膜の光ビーム照射部と非照射部との反射率変化を大きくするためのものであって、光記録材料と反応しないものが好ましく、例えば C u . A g . A u が光記録材料薄膜を構成する酸化ビスマスに対して安定なので特に好ましい。 (ホ)作用

酸化ビスマス、二酸化シリコン及び燐酸第二クロムの特定割合で混合された光記録材料が明確な反射率変化のしきい値温度を呈すると共にしきい 値温度以上に加熱されても結晶化を伴わない。

(へ)実施例

--648---

以下、本発明を実施例に基づき図面を参照して

-- 6 --

詳細に説明する。

実施例 1

光ディスクの作製

CrPO・とSiO・をモル比1:1で混合し、この混合物を換成法によってタブレットに成形する。このタブレット及び同様に挽成したBi,O,タブレットそれぞれを原料としてガラス基板と共に電子ビーム蒸發波圏内に配置し、電子ビーム蒸發法によって各原料の蒸発速度を調節して上記ガラス基板上にBi,O・/(CrPO・+SiO・)=8/1、CrPO・/SiO・=1/1のモル組成で200 n mの膜厚を有する光記録材料薄膜を形成する。更に反射構造とするため、反射膜のAg(銀)層を光記録材料薄膜上に約50 n m厚に形成し、第1図(a)に示すような光ディスクを作製する。ただし、1はガラス基板、2は光記録材料薄膜、3はAg反射層、4は光ビームである。

反射事変化に対するしきい値温度

上記光ディスクを100~225℃までの積々の温度

-7-

得られた光ディスクは、第1図(b)に示すように反射率に対するしきい値温度がやや不明確であった。

比较例 2

実施例1においてCrPO.とSiO.の混合物からなるタブレットを用いる代りに、このタブレットを用いずこの他は実施例1と同様にしてガラス基板上にBi.O.のみで200nmの膜厚を有する 光記録材料薄膜を形成して光ディスクを作製する。

得られた光ディスクは、第1図(b)に示すように反射率に対するしきい値温度が不明確であった。

実施例2

実施例 I において、ガラス基板を用いる代りにポリカーポネート樹脂基板(案内溝:1.6μmビッチ、ランド幅0.8μm、ランド記録)を用い、この他は実施例 I と同様にして光ディスクを作製する。 得られた光ディスクの記録再生特性をキャリア//イズ比(CNR)の記録周波数依存性を測定することによって評価した。ただし、ディスク

でアニーリングを行い、それぞれのアニーリング に対する反射率を測定した。この結果第1図(b) に示すように、上記光ディスクは、後述の比較例 で作製したものと比べて250~275℃の間で明確な 反射率変化のしまい値をもち、50%以上の反射率 変化が得られている。

X線回折

上記光ディスクを構成する光記録材料薄膜の X 線回折をアニーリング前と 300℃アニーリング後 で測定した。測定結果は、それぞれ第 2 図(a) 及び第 2 図(b)に示すように、しきい値温度以 上に加熱し、透明化しても結晶化等の構造変化を 伴わないことが分かる。

比較例1

実施例 I において、CrPO.とSiO.の混合物からなるタブレットを用いる代りに、溶融石英(SiO.)のタブレットを用いこの他は実施例 I と同様にしてガラス基板上に組成がBi.O./SiO.=8/Iで200 n mの順厚を有する光記録材料薄膜を形成して光ディスクを作製する。

-8-

回転数は、1800rpm、記録径半径は30mm、光ビ -ムは830nmレーザ光である。

この結果、第3図に示すように記録周波数が大きくなる(記録ビット長が短くなる)と後述の比較例の光ディスクは急激にCNRが低下するのに対し、この実施例で作製した光ディスクは短ビット長でも高いCNRが得られている。特に、記録信号周波数3.7MHzの条件で記録した0.76μm長のビットの再生CNRは、55dB以上が得られ、光記録材料として高い性能を有することが分かる。比較例3

実施例2において組成がBi,O,/(CrPO. +SiO.)=8/1の光記録材料薄膜間を形成する代りにBi,O./SiO.=6/1の光記録材料薄膜を形成し、 料薄膜を形成し、この他は実施例2と同様にして 光ディスクを作製する。

得られた光ディスクは、記録ビット及が短くなると急激にCNRが低下した。

比校例4

実施例1において、光記録材料薄膜の上に反射

膜のAg層を形成する代りに、AL暦(膜厚50ma)を形成し、この他は実施例1と同様にして光ディスクを作製する。

得られた光ディスクは、A1層成膜直後に既に成膜面積の40%程度が透明化し、更に室温保管中に透明領域が広がった。A1膜厚を100 n mとしたディスクでは、透明化はしないものの未紀縁状態での再生ノイズが高く、Ag反射膜ディスクの30%~50%程度のCNRしか得られなかった。この結果は薄膜形成法によらず、スパッタ法でA1を形成したディスクについても同じ結果が得られた。

(ト)発明の効果

この発明によれば、記録に伴うノイズを低減することができるとともに、大きな反射率変化を得ることができ、大きなCNRを得ることができる光記録材料及び光ディスクを提供することができる。特にこの発明の光記録材料及び光ディスクは、長時間記録と高いCNRを必要とする動画等のアナログ記録用として利用することができ、また物

質の移動を伴わない相変化型であるため、両面仕 様ディスクでは密替貼合わせ構造を採用すること ができ、高い信頼性を確保することができる。

4. 図面の簡単な説明

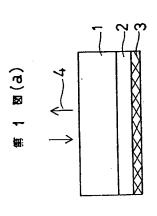
第1図(a)は、この発明の実施例で作製した 光ディスクの説明図、第1図(b)は、同じくアニール温度に対する反射率変化の説明図、第2図(a)(b)は、同じくX線回折の図、第3図は、同じく記録ピット長(記録周波数)に対するCNR(キャリア/ノイズ)の説明図である。

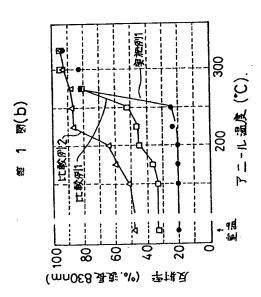
1 ······ ガラス基板、 2 ·····・・光記録材料薄膜、 3 ····· A g 反射層、 4 ····・・光ビーム。

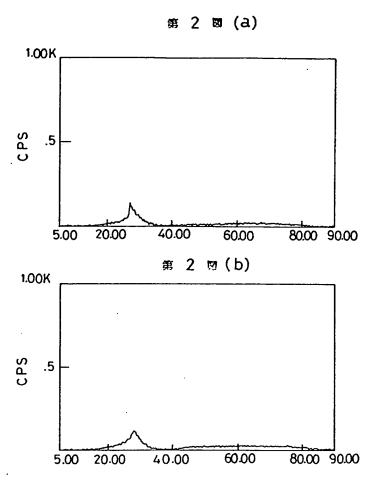
代理人 弁理士 野河 信太郎

- 12 -

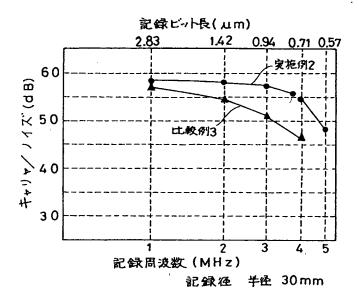
-11-







第 3 図



THIS PAGE BLANK (USPTO)